(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-147419

(P2000-147419A)

(43)公開日 平成12年5月26日(2000.5.26)

(51) Int.Cl.7 G02B 26/10

26/08

識別記号 104

FΙ

テーマコート\*(参考) 104Z 2H041

G 0 2 B 26/10

F

2H045

26/08

E

# 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平10-324092

(22)出願日

平成10年11月13日(1998.11.13)

(71)出顧人 000004329

日本ピクター株式会社

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

(72)発明者 井関 隆之

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

地 日本ピクター株式会社内

(72)発明者 菅野 泰弘

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

地 日本ピクター株式会社内

(74)代理人 100083806

弁理士 三好 秀和 (外9名)

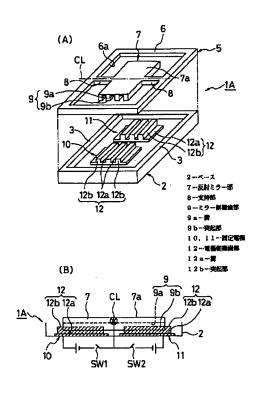
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 光偏向器及びこれを用いた表示装置

# (57)【要約】

【課題】 低い駆動電力の下でも高速で、且つ、広偏向 角で揺動することができると共に、反射ミラー部の剛性 にも問題が生じない。

【解決手段】 反射ミラー部7を一対の支持部8,8を 介してベース2に揺動自在に構成し、ベース2に一対の 固定電極10,11を配置し、この各固定電極10,1 1と反射ミラー部7との間に電圧を印加して静電力で反 射ミラー部7が一対の支持部8,8を揺動中心軸CLと して揺動する光偏向器1において、反射ミラー部7の裏 面には揺動中心軸CLに直交する方向に延びる溝9aと 突起部9bとから成るミラー側櫛歯部9を形成し、各固 定電極10,11の反射ミラー部7側には、ミラー側櫛 歯部9に噛み合い可能な溝12aと突起部12bとから 成る電極側櫛歯部12を形成した。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に光反射面を有する反射ミラー部 と、この反射ミラー部をベースに対して揺動自在に支持 する一対の支持部と、前記ベースの反射ミラー部側に配 置された一対の固定電極とを有し、この各固定電極と前 記反射ミラー部との間に電圧を印加して静電力で前記反 射ミラー部が前記一対の支持部を揺動中心軸として揺動 する光偏向器において、

1

前記反射ミラー部の裏面には前記揺動中心軸に直交する 成し、前記各固定電極の前記反射ミラー部側には、前記 ミラー側櫛歯部に噛み合い可能な溝と突起部とから成る 電極側櫛歯部を形成したことを特徴とする光偏向器。

【請求項2】 表面に光反射面を有する反射ミラー部 と、この反射ミラー部をベースに対して揺動自在に支持 する一対の支持部と、前記ベースの反射ミラー部側に配 置された一対の固定電極とを有し、前記反射ミラー部の 裏面には前記揺動中心軸に直交する方向に延びる溝と突 起部とから成るミラー側櫛歯部を形成し、前記各固定電 極の前記反射ミラー部側には、前記ミラー側櫛歯部に噛 20 み合い可能な溝と突起部とから成る電極側櫛歯部を形成 し、前記各固定電極と前記反射ミラー部との間に電圧を 印加して静電力で前記反射ミラー部が前記一対の支持部 を揺動中心軸として揺動する光偏向器を設け、

この光偏向器の前記反射ミラー部にレーザ光を照射し、 この照射されたレーザ光の反射光の方向を前記反射ミラ 一部の揺動によって変化させて投影画像を得ることを特 徴とする表示装置。

【請求項3】 前記請求項2に記載の表示装置におい

前記反射ミラー部からの反射光は、光アドレス型空間光 変調素子に照射することによって書き込み、この光アド レス型空間光変調素子に書き込んだ光情報を投影したこ とを特徴とする表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザビーム等の 光を反射させて光偏向を行う光偏向器、及び、この光偏 向器を用いた表示装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】電子写真式複写機、レーザビームプリン タ、バーコードリーダ等の光学機器の走査装置や、光デ ィスクのトラッキング制御装置の光偏向装置や、レーザ 光をスキャニングして映像を投影する表示装置などには 光偏光器が使用されている。

【0003】一般に、機械的に光偏向を行う光偏光器と しては、回転多面鏡(ポリゴンミラー)、騒動型反射鏡 (ガルバノミラー) 等があるが、ガルバノミラー型のも のはポリゴンミラー型のものに比べて機構が小型化で き、又、最近の半導体プロセス技術ではシリコン基板を 50 反射ミラー部55の略重心を通る軸上の両側と外補助べ

用いたマイクロミラーの試作例なども報告されており、 さらに小型化、軽量化、低コスト化が期待できる。

【0004】このようなガルバノミラー型の光偏向器の 従来例が図14~図17と図18とにそれぞれ示されて いる。

【0005】図14は第1従来例の光偏向器の分解斜視 図、図15はこの光偏向器の概略側面図である。図14 及び図15において、ベース50には左右一対の立設部 51、52が設けられ、この一対の立設部51,52上 方向に延びる溝と突起部とから成るミラー側櫛歯部を形 10 には振動体53が配置されている。振動体53は外枠部 54と、この外枠部54の開口部54aに配置された反 射ミラー部55と、この反射ミラー部55の略重心を通 る軸上の位置で反射ミラー部55と外枠部54とを連結 する一対の支持部56,56とから一体的に構成されて いる。外枠部54の左右両端部分が一対の立設部51, 52上に固定されており、一対の支持部56,56は外 枠部54に対して反射ミラー部55を支持すると共に、 この反射ミラー部55を振動させるための捩りバネの機 能を備えている。

> 【0006】又、ベース50上には左右一対の固定電極 57,58が配置され、この一対の固定電極57,58 は反射ミラー部55の左右両端部に対向する位置に配置 されている。この一対の固定電極57,58の相手側の 電極として反射ミラー部55が構成され、各固定電極5 7.58と反射ミラー部55との間には各切替スイッチ SW1, SW2を介して選択的に電圧を印加できるよう に構成されている。尚、反射ミラー部55は外枠部54 と一対の支持部56,56を介して接続されているた め、反射ミラー部55への電圧印加は外枠部54に印加 30 すれば良い。

【0007】上記構成において、一方の固定電極57と 反射ミラー部55との間に電圧が印加されたときには反 射ミラー部55の左側が静電力により吸引されて反射ミ ラー部55が一対の支持部56,56を揺動中心軸CL (図15に示す)として反時計方向に回転し、又、他方 の固定電極58と反射ミラー部55との間に電圧が印加 されたときには反射ミラー部55が静電力により吸引さ れて反射ミラー部55の右側が一対の支持部56,56 を揺動中心軸CL (図15に示す)として時計方向に回 転する。従って、切替スイッチSW1, SW2を交互に オン・オフ制御し、一対の固定電極57,58に交互に 電圧を印加することによって反射ミラー部55が左右に 揺動するものである。この反射ミラー部55に照射され た光は、反射ミラー部55の揺動によって反射角が変更 され、これによって光偏向される。

【0008】図18は第2従来例の光偏向器の分解斜視 図である。図18において、ベース50上には補助ベー ス部材60が固定され、この補助ベース部材60の開口 部60a内に反射ミラー部55が配置されている。この 20

ース部材60との間が一対の支持部56,56で連結さ れている。反射ミラー部55はこの一対の支持部56、 56を中心として揺動自在に構成されている。又、反射 ミラー部55の両外端部には櫛歯部61が構成されてお り、この各櫛歯部61に対向する補助ベース部60の位 置で、且つ、これより低い位置には固定電極57,58 がそれぞれ固定されている。この一対の固定電極57, 58の各反射ミラー部55側には前記櫛歯部61に噛み 合う櫛歯部62が構成されている。

【0009】上記構成において、一方の固定電極57と 10 反射ミラー部55との間に電圧が印加されたときには反 射ミラー部55の左側が静電力により吸引されて反射ミ ラー部55が一対の支持部56,56を揺動中心軸とし て反時計方向に回転し、又、他方の固定電極58と反射 ミラー部55との間に電圧が印加されたときには反射ミ ラー部55の右側が静電力により吸引されて反射ミラー 部55が一対の支持部56,56を揺動中心軸として時 計方向に回転する。従って、前記第1従来例と同様に、 一対の固定電極57,58に交互に電圧を印加すること によって反射ミラー部55が左右に揺動するものであ る。

## [0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記第 1及び第2従来例においては、以下に述べるような問題 があった。

【0011】即ち、第1従来例において、反射ミラー部 55を高速で揺動させるためには、反射ミラー部55の 重量がより軽い方が望ましい。ここで、図16で示すよ うに、軽量化のために反射ミラー部55の厚みtを薄く すると、光反射面が撓んでしまう等の不都合が生じ剛性 30 に問題がでる。

【0012】又、反射ミラー部55の偏向角(振れ角) を大きくするには、図17に示すように、反射ミラー部 55と固定電極57,58とのギャップ間隔を大きく設 定する必要がある。しかし、静電力は、ギャップの2乗 に反比例するので、必要な駆動力を得るには非常に大き な電圧を必要とする。

【0013】一方、前記第2従来例においては、第1従 来例と異なり、櫛歯部61,62の高さを大きく設定す れば偏向角を大きく取ることができ、櫛歯の数を多くす 40 れば低電圧で大きな駆動力が得られる。しかしながら、 反射ミラー部55の両外端部に櫛歯部61を設けるため に、反射ミラー部55が大型化するのは避けられない。 反射ミラー部55が大型化すると、反射ミラー部55の 共振周波数が低下するため、高速で揺動させることがで きない。特に、偏向角を大きく取るため、又は、低電圧 で大きな駆動力を得るため、櫛歯部61,62の高さを 大きく設定したり、櫛歯数を多くすることは反射ミラー 部55の重量の増量となり、さらなる共振周波数の低下 を招く。

【0014】そこで、本発明は、前記した課題を解決す べくなされたものであり、低い駆動電力の下でも高速 で、且つ、広偏向角で揺動することができると共に、反 射ミラー部の剛性にも問題が生じない光偏向器及びこれ を用いた表示装置を提供することを目的とする。

#### [0015]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、表面 に光反射面を有する反射ミラー部と、この反射ミラー部 をベースに対して揺動自在に支持する一対の支持部と、 前記ベースの反射ミラー部側に配置された一対の固定電 極とを有し、この各固定電極と前記反射ミラー部との間 に電圧を印加して静電力で前記反射ミラー部が前記一対 の支持部を揺動中心軸として揺動する光偏向器におい て、前記反射ミラー部の裏面には前記揺動中心軸に直交 する方向に延びる溝と突起部とから成るミラー側櫛歯部 を形成し、前記各固定電極の前記反射ミラー部側には、 前記ミラー側櫛歯部に噛み合い可能な溝と突起部とから 成る電極側櫛歯部を形成したことを特徴とする光偏向器 である。

【0016】請求項2の発明は、表面に光反射面を有す る反射ミラー部と、この反射ミラー部をベースに対して 揺動自在に支持する一対の支持部と、前記ベースの反射 ミラー部側に配置された一対の固定電極とを有し、前記 反射ミラー部の裏面には前記揺動中心軸に直交する方向 に延びる溝と突起部とから成るミラー側櫛歯部を形成 し、前記各固定電極の前記反射ミラー部側には、前記ミ ラー側櫛歯部に噛み合い可能な溝と突起部とから成る電 極側櫛歯部を形成し、前記各固定電極と前記反射ミラー 部との間に電圧を印加して静電力で前記反射ミラー部が 前記一対の支持部を揺動中心軸として揺動する光偏向器 を設け、この光偏向器の前記反射ミラー部にレーザ光を 照射し、この照射されたレーザ光の反射光の方向を前記 反射ミラー部の揺動によって変化させて投影画像を得る ことを特徴とする表示装置である。

【0017】請求項3の発明は、前記請求項2に記載の 表示装置において、前記反射ミラー部からの反射光は、 光アドレス型空間光変調素子に照射することによって書 き込み、この光アドレス型空間光変調素子に書き込んだ 光情報を投影したことを特徴とする表示装置である。

## [0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に 基づいて説明する。

【0019】図1~図4は本発明の第1実施形態を示 し、図1(A)は光偏向器1Aの分解斜視図、図1 (B)は光偏向器1Aの概略側面図、図2は光偏向器1 Aの斜視図、図3は光偏向器1Aの概略側面図、図4は 反射ミラー部7の裏面側の斜視図である。

【0020】図1~図4において、光偏向器1Aのベー ス2は偏平長方形状を有し、このベース2の全外周端に 50 は立設部3が一体的に突出形成されており、この立設部 3上に振動体5が配置されている。

【0021】この振動体5は、方形状の外枠部6と、この外枠部6の開口部6 a内に配置された反射ミラー部7と、この反射ミラー部7の略重心を通る軸上の位置で反射ミラー部7と外枠部6とを連結する一対の支持部8、8とから一体的に構成されている。そして、外枠部6が立設部3上に固定されており、反射ミラー部7は一対の支持部8、8を揺動中心軸CL(図1、図3に示す)として揺動自在に構成されている。反射ミラー部7の表面には光反射膜が膜付けされて光反射面7 aが形成されて 10 いる

【0022】また、図4に詳しく示すように、反射ミラ 一部7の裏面には前記揺動中心軸CLに直交する方向に 延びる溝9aと突起部9bとから成るミラー側櫛歯部9 が一体的に形成されている。この反射ミラー部7のミラ ー側櫛歯部9に対向するベース2上の位置には左右一対 の固定電極10,11が配置され、この一対の固定電極 10,11の上面側にも溝12aと突起部12bとから 成る電極側櫛歯部12が一体的に形成されている。そし 溝9a, 12aと他方の突起部9b, 12bとが互いに 対向する位置関係、つまり、互いに噛み合うように配置 されている。各固定電極10,11と反射ミラー部7と の間には各切替スイッチSW1,SW2を介して選択的 に電圧を印加できるよう構成されており、各切替スイッ チSW1、SW2を交互にオン・オフ制御し、一対の固 定電極11,12に交互に電圧を印加するように構成さ れている。

【0023】また、前記反射ミラー部7はその厚みが薄く形成され、且つ、ミラー側櫛歯部9及び電極側櫛歯1 302の高さ、具体的には溝9a,12aと突起部9b,12bとの噛み合いストロークは広い偏向角を得られるように高く形成されている。つまり、反射ミラー部7は全体として軽量で、共振周波数が高く構成されている。

【0024】上記構成において、図1(B)に示すように、一方の固定電極10と反射ミラー部7との間に電圧が印加されたときには反射ミラー部7の左側が静電力により吸引されて反射ミラー部7が一対の支持部8を揺動中心軸CLとして反時計方向に回転し、又、図3に示すように、他方の固定電極11と反射ミラー部7との間に40電圧が印加されたときには、一方の固定電極10の吸引力が解除され、捩じられた一対の支持部8が弾性復帰力により反射ミラー部7を元の位置に戻そうとすると共に、反射ミラー部7の右側が静電力により吸引されて反射ミラー部7が一対の支持部8を揺動中心軸CLとして時計方向に回転する。従って、切替スイッチSW1、SW2を交互にオン・オフ制御されると、一対の固定電極10,11に交互に電圧を印加することによって反射ミラー部7が左右に揺動するものである。この反射ミラー部7が左右に揺動するものである。この反射ミラー部7が左右に揺動するものである。この反射ミラー部7が左右に揺動するものである。この反射ミラー部7が左右に揺動するものである。この反射ミラー部7が左右に揺動するものである。この反射ミラー部7が左右に揺動するものである。この反射ミラー部7が左右に揺動するものである。この反射ミラー

5

反射角が変更され、これによって光偏向される。尚、反射ミラー部7への電圧印加は、この反射ミラー部7を接続している外枠部6に印加している。

【0025】ここで、反射ミラー部7の駆動力は、ミラー側櫛歯部9と電極側櫛歯部12との間に発生する静電力によって得られ、且つ、双方のギャップ間隔が揺動位置にかかわらず狭く一定であるため、低い電圧で大きな駆動力を得ることができる。尚、駆動力の大きさの程度は下記に詳述する。

【0026】そして、ミラー側櫛歯部9と電極側櫛歯部12との高さは、所望の偏向角を得るのに必要な高さに設定され、且つ、反射ミラー部7は軽量で共振周波数が高く構成されているため、低い電圧の下でも高速で、且つ、大きな偏向角で揺動させることができる。特に、反射ミラー部7を共振周波数で振動させると、反射ミラー部7が最大変位で振動するため、低電力で大きな回転力を得ることができる。

10,11の上面側にも溝12aと突起部12bとから 成る電極側櫛歯部12が一体的に形成されている。そし で、ミラー側櫛歯部9と電極側櫛歯部12とは、一方の 溝9a,12aと他方の突起部9b,12bとが互いに 対向する位置関係、つまり、互いに噛み合うように配置 されている。各固定電極10,11と反射ミラー部7と の間には各切替スイッチSW1,SW2を介して選択的 に電圧を印加できるよう構成されており、各切替スイッ が図られる。

【0029】平行平面電極の場合、静電力はギャプ間隔の2乗で大きくなるが、反射ミラー部7の偏向角を大きく取ろうとすると、このギャップ間隔を大きくする必要がある。従って、大きな静電力を得ることが困難になる。これに対し、櫛歯電極の場合、反射ミラー部7はギャップに対して平行に移動するので、ギャップ間隔は一定である。従って、ギャップ間隔は可能な限り小さくできるため、大きな静電力を得ることができる。さらに、櫛歯の数nを複数にすることができるので、静電力は上式のさらに2n倍になる。

組の櫛歯に働く静電力 f は、 $f = \epsilon V^2 \times 1/2 \times (2)$  $\times 10^{-4}$ ) = 2.  $5 \times 10^2 \times \varepsilon V^2$ となる。一組の櫛歯 には静電力の働く面が2面あり、又、櫛歯が50個ある ので、全体としての静電力Fは、 $F=2\times50$ f=2.  $5\times10^5\times\epsilon$  V<sup>2</sup> E  $\times$  V<sup>3</sup>

【0031】平行平面電極の場合、偏向角が±10度の とき反射ミラー部7の最端部が176μm変位するの で、それがギャップ間隔gとなる。従って、静電力F は、 $F = \varepsilon V^2 \times 1 \times 2 / 2 \times (176 \times 10^{-4})^2 =$ 3.  $2\times10^3\times\varepsilon$  V<sup>2</sup> E  $\times$  V<sup>2</sup> E  $\times$  S  $\times$ 

【0032】以上より、櫛歯電極にした場合、同じ電圧 で約80倍の静電力が得られることになる。さらに、櫛 歯電極の場合は、製造方法により櫛歯の数を増やした り、ギャップ間隔を狭くしたりすることも可能であり、 より大きな静電力を得ることも可能である。

【0033】図7は本発明の第2実施形態を示す光偏向 器1Bの裏面側の斜視図である。この第2実施形態にあ って前記第1実施形態と同一構成箇所は図面に同一符号 を付してその説明を省略し、異なる構成のみを説明す

【0034】即ち、図7に示すように、反射ミラー部7 の裏面側であって、且つ、一対の支持部8,8を通る揺 動中心軸CL上の位置には溝9aを設けずに、隣接する 突起部9b間を連結するリブ20が形成されている。こ の箇所は静電力の作用には無関係の箇所であるため、前 記第1実施形態と比べて同様な大きさの静電力が得られ ると共に、リブ20が反射ミラー部7の強度をさらに強 くするため、より剛性の向上となるものである。

【0035】図8及び図9は本発明の第3実施形態を示 し、図8及び図9はそれぞれ光偏向器10の概略側面図 30 である。図8及び図9において、この第3実施形態にあ って前記第1実施形態と比較してミラー側櫛歯部9と電 極側櫛歯部12との構成のみが相違し、他の構成は同一 であるため、ミラー側櫛歯部9と電極側櫛歯部12との 構成のみを説明し、その他の構成は図面に同一符号を付 してその説明を省略する。

【0036】即ち、この第3実施形態では、ミラー側櫛 歯部9と電極側櫛歯部12との揺動方向(揺動中心軸C しに直交する方向)の長さが反射ミラー部7の揺動方向 の長さよりも短く形成されている。このようにすること 40 いた他の表示装置の概略構成図である。図13におい によって、反射ミラー部7の自由端(外側端部)が固定 電極10,11又はベース2に衝突するまでの角度が大 きくできるため、偏向角を大きくすることができる。図 9は一方の固定電極10と反射ミラー部7間に電圧を印 加した状態を示し、第1実施形態の図3の場合に比べて 揺動角が大きくなっていることが分かる。

【0037】図10及び図11は本発明の第4実施形態 を示し、図10及び図11は光偏向器10の概略側面図 である。図10及び図11において、この第4実施形態

と電極側櫛歯部12との構成のみが相違し、他の構成は 同一であるため、ミラー側櫛歯部9と電極側櫛歯部12

との構成のみを説明し、その他の構成は図面に同一符号

を付してその説明を省略する。

【0038】即ち、この第4実施形態では、ミラー側櫛 歯部9と電極側櫛歯部12との高さが、揺動中心軸CL から遠ざかるに従って低くなるように形成されている。 このようにすることによって、反射ミラー部7と固定電 極10,11との間隔を狭く設定しても反射ミラー部7 10 の自由端(外側端部)が固定電極10,11に衝突する までの角度が大きくできるため、偏向角を大きくするこ とができる。図11は一方の固定電極10と反射ミラー 部7間に電圧を印加した状態を示し、第1実施形態の図 3の場合に比べて揺動角が大きくなっていることが分か る。

【0039】以上、前記第1~第4実施形態によれば、 低電圧の下でも高速で、且つ、広偏向角の揺動を行うこ とができるが、各光偏向器1A~1Dの内部を陽極接合 等の方法を用いて真空封止すれば反射ミラー部7の揺動 20 に対し空気抵抗の影響をなくすことができ、より高速に 揺動可能となり好ましい。

【0040】図12は、上記各光偏向器1A~1Dを用 いた表示装置の概略構成図である。図12において、レ ーザ光源30より発射されたレーザ光は、水平走査用光 偏向子31に照射される。水平走査用光偏向子31は水 平周波数に同期して反射ミラー部が揺動され、この揺動 によって反射光が水平方向に走査される。ここで反射さ れたレーザ光は垂直走査用光偏向子32に照射される。 この垂直走査用光偏向子32は垂直周波数に同期して反 射ミラー部が揺動され、この揺動によって反射光が垂直 方向に走査される。ここで反射されたレーザ光がスクリ ーン33に照射される。

【0041】水平走査用光偏向子31として上記各光偏 向器1A~1Dを用いられており、上記したように高速 で、且つ、広偏向角で揺動できるため、数十kHzの走 査周波数に同期させて揺動させることができる。もちろ ん、垂直走査用光偏向子32にも上記各光偏向器1A~ 1Dを用いても良い。

【0042】図13は、上記各光偏向器1A~1Dを用 て、レーザ光源30より発射されたレーザ光は、水平走 査用光偏向子31に照射される。水平走査用光偏向子3 1は水平周波数に同期して反射ミラー部が揺動され、こ の揺動によって反射光が水平方向に走査される。ここで 反射されたレーザ光は垂直走査用光偏向子32に照射さ れる。この垂直走査用光偏向子32は垂直周波数に同期 して反射ミラー部が揺動され、この揺動によって反射光 が垂直方向に走査される。ここで反射されたレーザ光が 集束レンズ34を通って光アドレス型空間変調素子35 にあって前記第1実施形態と比較してミラー側櫛歯部9 50 に照射される。光アドレス型空間変調素子35はこの光

情報を書き込み、これを表面側に明度、輝度等を増幅して液晶で表示する。

【0043】一方、ランプ36からの光は赤外線カットフィルタ37、レンズ38、波長フィルタ39を通ってポラリゼーション・ビームスプリッタ40に入射され、この反射光が光アドレス型空間変調素子35を反射した光は再びポラリゼーション・ビームスプリッタ40に入射され、ここを透過した光がレンズ41を介してスクリーン33に照射される。

【0044】水平走査用光偏向子31として上記各光偏向器1A~1Dを用いられており、上記したように高速で、且つ、広偏向角で揺動できるため、数十kHzの走査周波数に同期させて揺動させることができる。もちろん、垂直走査用光偏向子32にも上記各光偏向器1A~1Dを用いても良い。

【0045】尚、前記実施形態によれば、光偏向器の適用例として表示装置を示したが、電子写真式複写機、レーザビームプリンタ、バーコードリーダ等の光学機器の走査装置や、光ディスクのトラッキング制御装置の光偏 20 向装置等にも適用できることはもちろんである。

## [0046]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1の発明に よれば、反射ミラー部が一対の支持部を揺動中心軸とし て静電力による揺動する光偏向器において、反射ミラー 部の裏面には前記揺動中心軸に直交する方向に延びる溝 と突起部とから成るミラー側櫛歯部を形成し、一対の固 定電極の前記反射ミラー部側には、前記ミラー側櫛歯部 に噛み合い可能な溝と突起部とから成る電極側櫛歯部を 形成したので、ミラー側櫛歯部と電極側櫛歯部との高さ 30 である。 を、所望の偏向角を得るのに必要な高さに設定してもミ ラー側櫛歯部と電極側櫛歯部とのギャップ間隔が変化せ ず、又、反射ミラー部の裏面側にミラー側櫛歯部を形成 したことから反射ミラー部の大きさを光反斜面に必要な 最少限の大きさに形成すればよいこと、及び、ミラー側 櫛歯部の突起部が強度リブとして機能することから反射 ミラー部の厚みを薄く形成しても剛性を維持できること から反射ミラー部を軽量で共振周波数を高いものに構成 できるため、低い電圧の下でも高速で、且つ、大きな偏 向角で揺動させることができると共に、反射ミラー部の 40 剛性にも問題が生じない。

【0047】請求項2の発明によれば、反射ミラー部を一対の支持部を中心にベースに対して揺動自在に構成し、ベースの反射ミラー部側に一対の固定電極を配置し、前記反射ミラー部の裏面にはミラー側櫛歯部を形成し、前記各固定電極の前記反射ミラー部側には、前記各固定電極と前記反射ミラー部との間に電圧を印加して静電力で前記反射ミラー部が前記一対の支持部を揺動中心軸として揺動する光偏向器を設け、この光偏向器の前記50

反射ミラー部にレーザ光を照射し、この照射されたレーザ光の反射光の方向を前記反射ミラー部の揺動によって変化させて投影画像を得るように構成したので、走査周波数の高い画像を表示できる。

10

【0048】請求項3の発明によれば、前記請求項2に 記載の表示装置において、前記反射ミラー部からの反射 光は、光アドレス型空間光変調素子に照射することによ って書き込み、この光アドレス型空間光変調素子に書き 込んだ光情報を投影したので、光アドレス型空間変調素 10 子を用いて走査周波数の高い画像を表示できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】(A)は本発明の第1実施形態に係る光偏向器の分解斜視図、(B)は同光偏向器の概略側面図である

【図2】本発明の第1実施形態に係る光偏向器の斜視図である。

【図3】本発明の第1実施形態に係る光偏向器の概略側 面図である。

【図4】本発明の第1実施形態を示す反射ミラー部の裏 ) 面側の斜視図である。

【図5】(A)は本発明の櫛歯電極の場合における静電力を説明するための側面図、(B)は第1従来例の平行平面電極の場合における静電力を説明するための側面図である。

【図6】 静電力の具体的大きさを説明するための反射ミラー部の斜視図である。

【図7】本発明の第2実施形態を示す反射ミラー部の裏面側の斜視図である。

【図8】本発明の第3実施形態を示す光偏光器の側面図 である。

【図9】本発明の第3実施形態を示す光偏光器の側面図である。

【図10】本発明の第4実施形態を示す光偏光器の側面 図である。

【図11】本発明の第4実施形態を示す光偏光器の側面 図である。

【図12】光偏向器を用いた表示装置の概略構成図である。

【図13】光偏向器を用いた他の表示装置の概略構成図 0 である。

【図14】第1従来例の光偏向器の分解斜視図である。

【図15】第1従来例の光偏光器の側面図である。

【図16】第1従来例の光偏光器にあって反射ミラー部の厚みを薄くした場合の側面図である。

【図17】第1従来例の光偏光器にあって反射ミラー部とベースとのギャップ間隔を広くした場合の側面図である。

【図18】第2従来例の光偏向器の分解斜視図である。 【符号の説明】

1A~1D 光偏光器

(7)

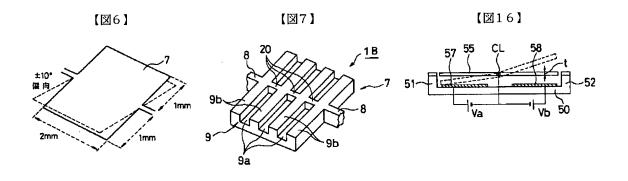
9 b 突起部

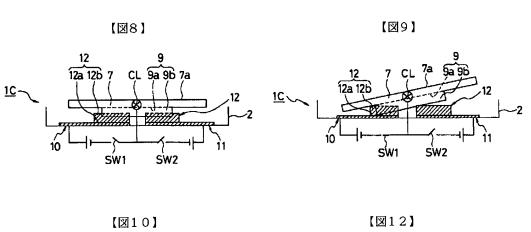
11

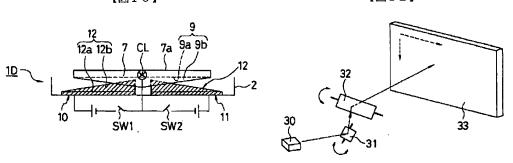
2 ベース

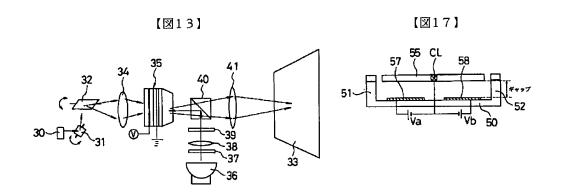
特開2000-147419

12

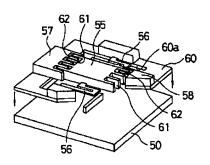








【図18】



フロントページの続き

(72)発明者 奥村 実紀雄 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3丁目12番 地 日本ビクター株式会社内 (72)発明者 柳生 慎悟 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番 地 日本ビクター株式会社内 Fターム(参考) 2H041 AA11 AB14 AC06 AZ02 2H045 AB16 BA18 DA32 CLIPPEDIMAGE= JP02000147419A

PAT-NO: JP02000147419A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000147419 A

TITLE: LIGHT DEFLECTOR AND DISPLAY DEVICE USING THE SAME

PUBN-DATE: May 26, 2000

INVENTOR - INFORMATION:

NAME COUNTRY
IZEKI, TAKAYUKI N/A
SUGANO, YASUHIRO N/A
OKUMURA, MIKIO N/A
YAGYU, SHINGO N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY VICTOR CO OF JAPAN LTD N/A

APPL-NO: JP10324092

APPL-DATE: November 13, 1998

INT-CL (IPC): G02B026/10;G02B026/08

## ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a light deflector capable of rocking at high speed and at a wide deflecting angle even under low driving power and also making a reflection mirror part have very high rigidity.

SOLUTION: In this deflector 1, the reflection mirror part 7 is constituted to freely rock on a base 2 through a pair of supporting parts 8 and 8, a pair of fixed electrodes 10 and 11 is arranged on the base 2, and the mirror part 7 is rocked with a pair of supporting parts 8 and 8 as a rocking center axis CL by electrostatic force by applying voltage to space between the electrodes 10 and

11 and the mirror part 7. Then, a mirror side comb-line

part 9 consisting of a groove 9a and a projection part 9b extended in a direction orthogonal to the center axis CL is formed on the back surface of the mirror part 7, and an electrode side comb-line part 12 consisting of a groove 12a and a projection part 12b which can be meshed with the mirror side comb-line part 9 is formed on the mirror part 7 side of the electrodes 10 and 11.

COPYRIGHT: (C) 2000, JPO

• • • • • • •

DERWENT-ACC-NO: 2000-418429

DERWENT-WEEK: 200036

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Optical deflector for scanner, has one set of

grooves and projections

which are formed on rear of mirror, are meshed with grooves

and projections of

fixed electrodes respectively

PATENT-ASSIGNEE: VICTOR CO OF JAPAN [VICO]

PRIORITY-DATA:

1998JP-0324092 (November 13, 1998)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 2000147419 May 26, 2000 N/A

009 G02B 026/10

Α

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP2000147419A N/A 1998JP-0324092

November 13, 1998

INT-CL (IPC): G02B026/08; G02B026/10

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000147419A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - A reflecting mirror (7) is rockably supported to a base (2) via

supports (8) in center axis (CL). Fixed electrodes (10,11) are configured on

the base. Voltage is impressed between the electrodes and the mirrors.

Grooves (9a) and projections (9b) formed on rear of mirror along orthogonal

direction of center axis, are meshed with the grooves (12a) and projections

(12b) of the fixed electrodes, respectively.

USE - For scanner of electrophotographic copier, laser printer, barcode reader, etc.

ADVANTAGE - Since the projection of mirror functions as strong rib, the reflecting mirror can oscillate on large extensive deflection square at lightweight. Since the resonance frequency is high, high speed also under low driving voltage is obtained. High image of scanning frequency can be displayed using optical address type space modulation element.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the exploded perspective and schematic side views of optical deflector.

Base 2

1. 1

Mirror 7

Support 8

Grooves 9a,12a

Projections 9b,12b

Fixed electrodes 10,11

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/18

DERWENT-CLASS: P81 T04

EPI-CODES: T04-G04A1;